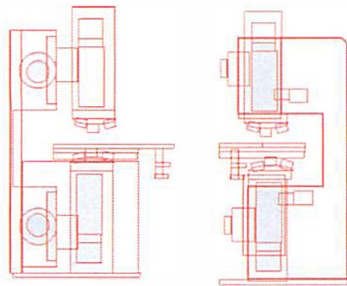


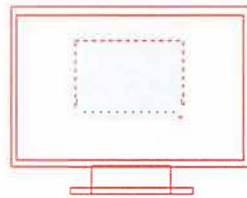
## 小型 MEMS 両面顕微鏡 TMA200

小さいワーク用の MEMS 両面顕微鏡で高性能シンプル構成です。ワークを表裏両面から顕微鏡カメラでモニターして表説のマークのズレや線幅を画像測定ができます。

両面顕微鏡の操作は手動で4"ステージと表裏顕微鏡をマイクロPCにM proソフトで上下の画像選択、AJUST表示、計測とデータ管理がマウス操作で簡単にできます。



小器、11A1S●●● 1.5v200

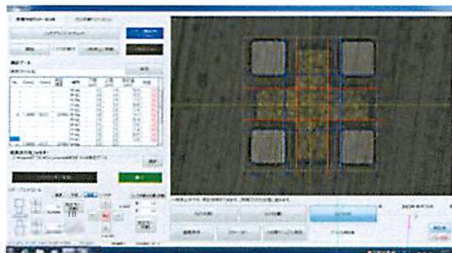


、MICRO PC



セミオートTMA2000Aの姉妹機

1. 測定精度 : 表裏マークおよびズレ測定  $1\mu\text{m}$ 、幅測定  $0.1\mu\text{m}$



2. 構成; 本 (本/両面顕微鏡組、対物5,10各2個、PC/モニタ、ソフト、マニュアル、保証書
3. パターンマッチング、自動計測など専用ソフト機能を追加できます。分離装束組込可能です。

## 1. 画面説明

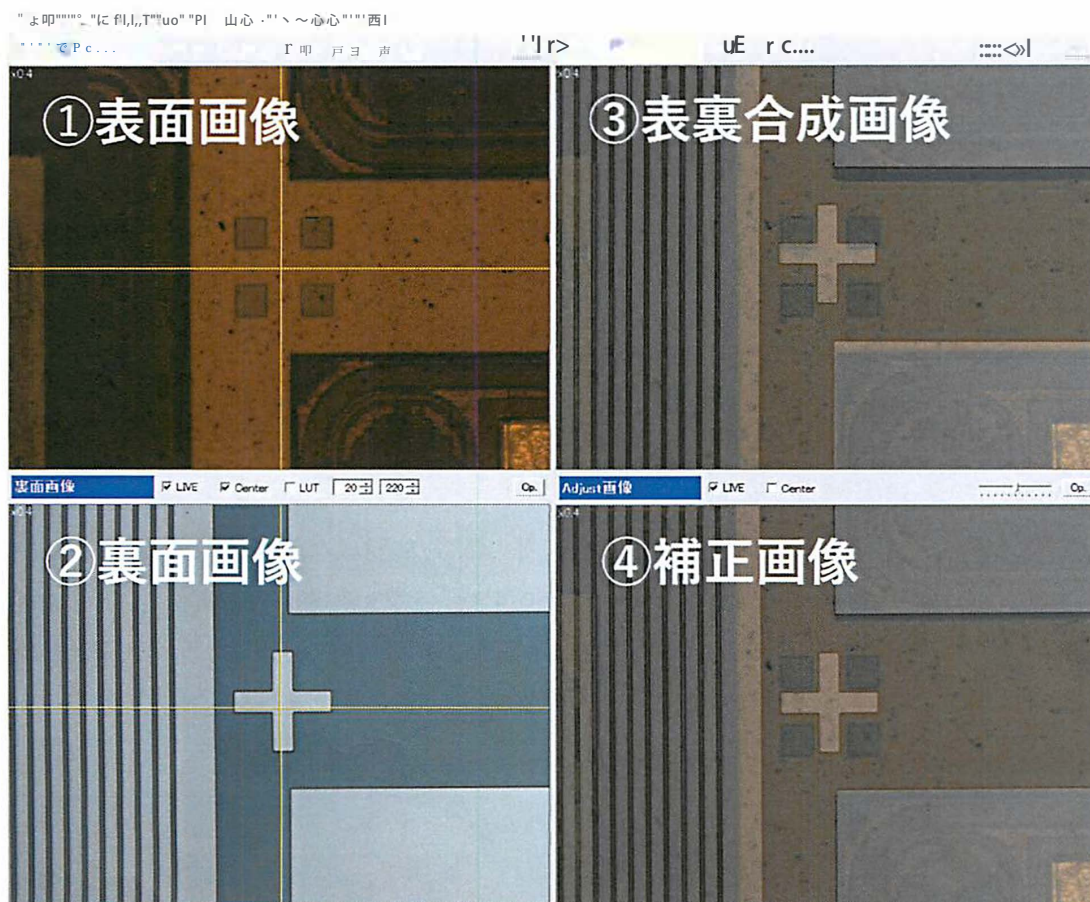


図.1 画面表示

- ①表面側顕微鏡カメラ取り込み映像
- ②裏面側顕微鏡カメラ取り込み映像
- ③表裏顕微鏡カメラ合成映像
- ④表裏の光学系の物理的光軸ズレ・倍率ズレを補正した映像

※各分割映像は拡大縮小表示及び選択した映像のみの表示が可能